ALN CERAMIC HEATER AND MANUFACTURE THEREOF

Patent number:

JP4324276

Publication date:

1992-11-13

Inventor:

UDAGAWA ETSURO; MURA NAOMI; MAEDA EIZO;

KUMAGAI MASATO

Applicant:

KAWASAKI STEEL CO

Classification:

- international:

C04B35/58; H05B3/14; H05B3/20; H05K1/03; H05K1/09

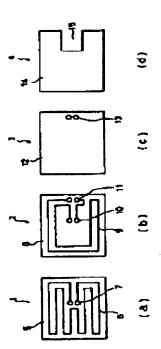
- european:

Application number: JP19910094355 19910424 Priority number(s): JP19910094355 19910424

Report a data error here

Abstract of JP4324276

PURPOSE: To manufacture a ceramic heater of which both surfaces are flat and without protruding an electrode part by contriving uniformity of temperature distribution in a base unit of the ceramic heater, internally furnished with a heating resistor by laminating an AIN substrate, utilizing bear holes as a method of taking out the electrode part to the outside and providing a notch in a brazing part of the electrode part to an external wiring. CONSTITUTION: The first layer substrate 1 has a heating resistor 6 and a terminal 7 in an upper total surface of a ceramic substrate 5. In the second layer substrate 2 has a heating resistor 9 in a peripheral edge part in an upper surface of a ceramic substrate 8. The third layer substrate 3 has vertical through viaholes 13 in a ceramic substrate 12. In the fourth layer substrate 4, the terminal 7 of the first layer substrate 1, having a notch 15, is provided in a position opposed to a beer hole 10 of the second layer substrate 2. A terminal 11 of the second layer substrate 2 is provided in a position opposed to the viahole 13 of the third layer substrate 3. The notch 15 of the fourth layer substrate 4 is provided in a position opposed to the viahole 13 of the third layer substrate 3.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

ALN CERAMIC HEATER AND MANUFACTURE THEREOF

CLAIMS

1. An AlN ceramic heater comprising a substrate having a resistance heating element on an upper-surface

wherein another substrate having a via hole electrode and an uppermost layer substrate having a notch corresponding to an area of the electrode are laminated on said substrate having the resistance heating element.

2. The AlN ceramic heater according to claim 1,

wherein said substrate having the resistance heating element on the upper surface is a plurality of laminated bodies and has a conducting via hole to connect said resistance heating element on the substrate.

 The AlN ceramic heater according to claim 1 or 2, wherein

the substrates are AlN sintered bodies having a thermal conductivity of 160 $\text{W/m} \cdot \text{K}$ or more, and

the resistance heating element comprises W-AlN composite sintered body, has an electric resistivity of $10^{-3}~\Omega$ · cm or less at room temperature and has positive temperature coefficient of resistance.

4. A manufacture method of the AlN ceramic heater according to claim 1, 2 or 3,

wherein

the resistance heating element is formed by thick film printing method and

the resistance heating element is embedded in a ceramic base body by green sheet laminating method.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-324276

(43)公開日 平成4年(1992)11月13日

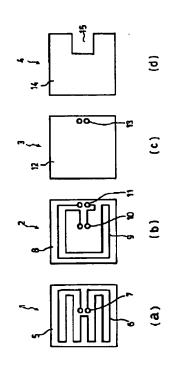
識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
393	7913-3K		
104 Y	8821 -4G		
В	8715-3K		
Н	7011-4E		
В	8727-4E		
		\$	審査請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁)
特顧平3-94355		(71)出願人	000001258
			川崎製鉄株式会社
平成3年(1991)4月	24日	ł	兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28
			号
,		(72)発明者	字田川 悦郎
			千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技
			術研究本部内
		(72) 窑阳麦	
		(12/75717	千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技
			術研究本部内
		(24) (379)	
		(74)代理人	弁理士 小杉 佳男 (外1名)
			最終頁に続く
	3 9 3 1 0 4 Y B H B	3 9 3 7913-3K 1 0 4 Y 8821-4G B 8715-3K H 7011-4E B 8727-4E	3 9 3 7913-3K 1 0 4 Y 8821-4G B 8715-3K H 7011-4E B 8727-4E

(54) 【発明の名称】 A 1 Nセラミツクヒータ及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 A 1 N基板を積層して発熱抵抗体を内装させた セラミックヒータの基体内の温度分布の均一化を図る。 また電極部を外部へ取出す方法として、ピアホールを利 用し、電極部と外部配線とのろう付け部に切欠を設ける ことによって、電極部が突出しない、両面が平坦なセラ ミックヒータを製造する。

【構成】第1層基板1はセラミック基板5の上面全面に 発熱抵抗体6、端子7を有する。第2層基板2はセラミック基板8の上面の周縁部に発熱抵抗体9を有する。第 3層基板3はセラミック基板12に上下貫通ピアホール 13を有する。第4層基板4は切欠15を有する第1層 基板1の端子7は、第2層基板2のピアホール10対向 する位置に設けられている。第2層基板2の端子11 は、第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設 けられている。第4層基板4の切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の上面に発熱抵抗体を設け、その上 にピアホール電極を有する基板及び該電極部に対応する 切欠を有する最上層基板を積層してなることを特徴とす るAINセラミックヒータ。

【請求項2】 上面に発熱抵抗体を設けた基板が複数の 糟層体であり、該基板上の発熱抵抗体を結合する導通ビ アホールを有することを特徴とする請求項1記載のA1 Nセラミックヒータ。

AIN質焼結体であり、発熱抵抗体がW-AINの複合 焼結体からなり10-3Ω・cm以下の室温時の電気抵抗 率及び正の抵抗温度係数を有することを特徴とする請求 項1又は2記載のAlNセラミックヒータ。

【請求項4】 厚膜印刷法によって発熱抵抗体を形成 し、該発熱抵抗体をグリーンシート積層法によりセラミ ック基体中に埋設することを特徴とする請求項1、2又 は3記載のAINセラミックヒータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、家庭用機器、電子機 器、産業用機器、及び自動車等に利用されるセラミック ヒータ及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】これまでにセラミックスを基体とするヒ **ータとしては、W(タングステン)−アルミナ系、ある** いはMo(モリプデン)-アルミナ系において実用化が 図られており、多くの製品がでている。このようなアル ミナ系におけるセラミックヒータは基体が電気的、化学 的に安定であるばかりでなく、発熱抵抗体の電気的特 30 性、熱的特性に関して設計上に多くの利点を有する。

【0003】しかし、アルミナは熱膨張が大きく、熱伝 導が悪いことから急激な温度変化に弱く、耐熱衝撃温度 が150~250℃と低い。さらに、熱伝導性に劣るこ とから、プレート状の基体の場合には、通電時に発熱部 とプレート周辺部の温度差が大きくなりやすく、被加熱 物に対する熱伝達効率が低いといった問題がある。ま た、家庭用機器、電子機器、産業用機器及び自動車用と 広く用いられいているセラミックヒータ一般に対し、

- (1) 設定の温度への到達時間の短縮
- (2) 熱サイクル及び電圧印加サイクルにおける、電 気的、機械的信頼性の向上
- (3) 熱伝達効率の向上
- (4) 使用環境に対する耐性の向上

などの要求が高まってきている。このような要求に対 し、アルミナを基体とした既存のセラミックヒータでは 十分に応えられなくなっている。

【0004】そこで、従来のアルミナに代る基体とし て、窒化アルミニウム (A1N) 又は窒化ケイ素などの セラミックスが注目されている。これらは機械的な強度 50 化物、あるいはWの酸化物からの変成物よりなる少なく

2 に優るだけでなく、特に、AlNは熱膨張が小さい上

に、熱伝導率がアルミナの10倍程度もあることなどか ら、新しいセラミックヒータ用の基体として有望視され

【0005】しかし、A1Nはアルミナと比べ単身でも 焼結が難しく、発熱抵抗体を内蔵したものはいまだに実 現していない。これはAlNの焼成が一般には1800 ℃以上という高温でなされることと、脱脂及び窒素不雰 囲気でなされることが原因で、AINと同時に焼成でき 【請求項3】 基板が熱伝導率160₩/m・K以上の 10 る材料が限られているためである。これまでに、A l N と同時に焼成できる材料としてWやMoをはじめとする 高融点金属を用いた開発が進められてきたが、AINと の焼結性の一致をはかりながら所望の物性値を得ること が困難であった。

> 【0006】また、発熱抵抗体のパターンをセラミック 焼結体内に形成する方法も、単純なものに限られてお り、このためプレート状の基体表面での温度分布が不均 一となったりする場合が多い。

[0007]

20 【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来からあ るセラミックシートの積層技術と厚膜印刷技術、さらに はスルーホールメタライズ技術を用いて、発熱抵抗体を 内蔵したセラミックヒータを開発するにあたり、プレー ト状の基体内の温度分布の均一化を図ることを目的とす る。また電極部を外部へ取出す方法として、ピアホール を利用する技術、さらには電極部と二クロム線等の外部 配線との基体中におけるろう付け部に切欠を設けること によって、電極部が突出しない、すなわち両面が平坦な セラミックヒータを製造する技術を提供する。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板の上面に 発熱抵抗体を設け、その上にピアホール電極を有する基 板及び該電極部に対応する切欠を有する最上層基板を積 層してなることを特徴とするAINセラミックヒータで ある。この場合、上記上面に発熱抵抗体を設けた基板を 複数の積層体とし、これらの基板上の発熱抵抗体を導通 ピアホールで結合すると好適である。

【0009】また、本発明のAINセラミックヒータは その好ましい実施監様として、基板が熱伝導率160W 40 /m・K以上のA 1 N質焼結体であり、発熱抵抗体はW -AlNの複合焼結体からなり室温時の電気低効率が1 0-1Ω・c m以下でかつ抵抗温度係数が正であるセラミ ックヒータを提供する。また、上配のようなセラミック ヒータの製造方法としては、厚膜印刷法によって発熱抵 抗体を形成し、グリーンシート積層法によって発熱抵抗 体をセラミック基体中に埋設する。

[0010]

【作用】本発明は、A1Nを基体としたセラミックヒー タであって、内蔵された発熱抵抗体として、W、Wの酸

とも1種類以上の主成分と、基体となるA1Nとの複合 焼結体を用いる。本発明はこのような場合のセラミック ヒータ基体の構造及び発熱抵抗体のパターンの配列、並 びに電極の外部への取り出し構造を改善したものであ る.

【0011】本発明は次の作用を生じる。

- ヒータパターンを積層し、3次元配線とするこ とによって、熱密度を向上させる。
- (2) 基体内の温度分布が均一化する。
- って、端子を基体外部へ露出させない。

【0012】(4) 最上層基板は切欠を設けた構造に より、立体的な基体とし、外部電極部の突出部をなく し、両面が平坦となるようにする。

[0013]

【実施例】図1、図2に、本発明の実施例の説明図を示 した。実施例は4層積層体である。第1層基板1はセラ ミック基板5の上面全面に発熱抵抗体6、端子7を有す る。第2層基板2はセラミック基板8の上面の周縁部に 発熱抵抗体9を有する。第3層基板3はセラミック基板 20 12に上下貫通ビアホール13を有する。第4層基板4 は切欠15を有する第1層基板1の端子7は、第2層基 板2のピアホール10対向する位置に設けられている。 第2層基板2の端子11は、第3層基板3のピアホール 13に対向する位置に設けられている。第4層基板4の 切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位 置に設けられている。

【0014】次に実施例の製造方法を説明する。平均粒 径1. 2μmのA1N粉末 (酸素含有量0.65重量 %、カーボン含有量0.02重量%)に、平均粒径0、 5 μmのY2 O2 を 2. 5 重量%を添加し、ポリビニル プチラール (PVB) を適量加えAINスラリーとし た。このスラリーより、ドクタープレード法にて厚さ約 1 mmのグリーンシートを成形し、さらに65×65m m角に打ち抜き加工した。

【0015】外形加工の後、図1に示すように、グリー ンシートのピアホール10、13の位置にスルーホール を形成し、さらに切欠15を打ち抜いた。引き続き、W 粉末 (平均粒径1. 3 μm) 、WOs 粉末 (10 μm) を重量比で3:1となるように配合したのちシートと同 40 UAIN粉末を体積比で1:1となるように加え、エタ ノールを溶媒として用い、アルミナポールによる温式の ミリングを12時間行った。引き続き有機結合剤として PMMA(ポリメチル・メタ・アクリレート)と、酢酸 プチルを適量加え12時間のミリングを行った後、テレ ピネオールを適量加えて粘度を調整し、三本ロールミル を通し、印刷用ペーストとした。

【0016】このベーストをA1Nグリーンシート上に スクリーンマスクを用い厚さ約15μmのヒータパター ン (図1に示す発熱抵抗体6、9) を形成した。またス 50 6,9

ルーホール10、13にも同様にペーストを充填した。 乾燥後、荷重400kg/cm²、温度130℃で図2 に示すように、積層した。ついで、1.6 tのCIP (冷間等方プレス) をかけた。

【0017】積層体を湿潤水素(Nz -8%Hz)雰囲 気で、600℃、8時間の脱脂を行った。引き続き、窒 素雰囲気中で1840℃、6時間の焼成を行い図3に示 す焼結体20を得た。ピアホール13の露出部にNI-Bメッキを施して電極とし二クロム線16をろう付けし 積層方向の導通はピアホールを用いることによ 10 た。焼結体 20 は、基板 $1\sim4$ の積層体である。同種の 積層体をアルミナを基板として製造し、比較例とした。

> 【0018】実施例及び比較例について通電試験(約5 秒で800℃となるように100Vを印加)を行い、プ レート状基体の温度分布をサーモピューアにより観察し た。100V印加1秒後の温度分布及び5秒後の定常状 態における観察結果を図4~図7に示した。図4は実施 例の上面、図5は実施例の下面を示し、それぞれ100 V印加1秒後(a)に示すように、200℃のリング状 の領域21と、250℃のコア領域22が観察され、5 秒後には(b)に示すように800℃の一様な加熱域2 3が観察された。図6は比較例の上面、図7比較例の下 面を示し、それぞれ100V印加1秒後(a)に示すよ うに、150℃の領域24と島状の領域25とを生じ、 5秒後に(b)に示すように800℃の定常状態におい ても700℃の周縁領域26、750℃の中央領域2 7、800℃の電極近傍領域28を生じ、一様な加熱状 盤とならなかった。

[0019]

[発明の効果] 以上に述べたように本発明によると、基 体にA1Nを用い、プレート内の温度分布の均一性が著 しく向上したセラミックヒータを実現することができ る.

【図面の簡単な説明】

- 【図1】実施例の4枚の基板の平面図である。
- 【図2】実施例のセラミックヒータの積層構造を示す斜 視図である。
- 【図3】実施例のセラミックスヒータの(a)平面図、
- (b) 側面図である。
- 【図4】 サーモビュアによる実施例の観察面の説明図で
- 【図5】サーモビュアによる実施例の観察面の説明図で
- 【図6】サーモビュアによる比較例の観察面の説明図で
- 【図7】サーモビュアによる比較例の観察面の説明図で ある。

【符号の説明】

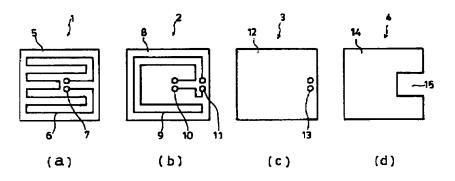
- 1, 2, 3, 4 基板
- 5, 8, 12, 14 セラミック基板
- 発熱抵抗体

5

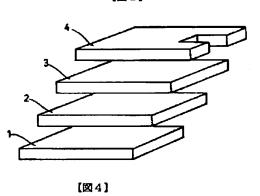
7, 11 **端子** 10, 13 ピアホール 15 切欠 16 ニクロム線

20 焼結体

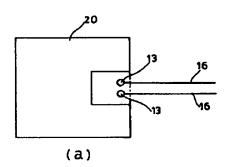
【図1】

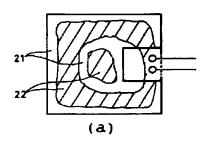


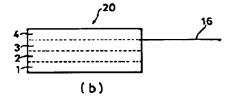
[図2]

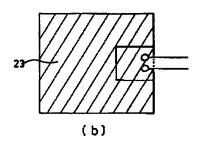


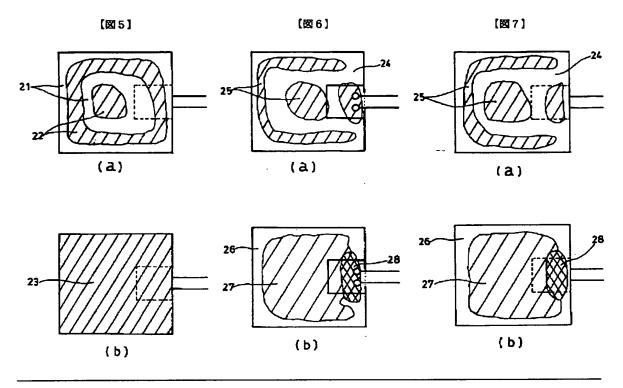
[図3]











フロントページの続き

(72)発明者 前田 榮造 千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技 術研究本部内 (72)発明者 組谷 正人 千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技 術研究本部内